

エックス線光電子分光装置活用セミナーの御案内

日頃よりハイテクプラザをご利用いただき有り難うございます。

当所では県内企業のものづくり技術をサポートするために、本年度 JKA 補助事業によりエックス線光電子分光装置を導入いたしました。

エックス線光電子分光装置 (XPS) は nm オーダーの極表面の分析が可能な装置で、医療機器、半導体、材料、ナノテク等の各分野での研究開発や品質管理に利用することが可能です。

本セミナーでは、エックス線光電子分光の原理から、得られるデータを理解するための基礎知識までを、各種表面分析法の特徴や違いと合わせて解説いたします。

この機会に是非ご参加下さい。お申し込みをお待ちしています。

記

日 時 平成31年2月14日(木) 13:30~16:30 (講演のみ参加の方は14:00より)

会 場 ハイテクプラザ 3F 会議室

内 容 1 見学第1部(13:30~14:00) *希望者のみ 先着10名様

2 講演(14:00~16:00)

・各種表面分析手法について

・XPSの基礎、スペクトルの原理・解析、各種測定法について

・完全自動エックス線光電子分光装置 K-Alpha について

3 見学第2部(16:00~16:30) *希望者のみ 先着10名様

講 師 サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

XPS 担当マネージャー 齋藤 健 氏

定 員 20名

参加費 無料

申 込 平成31年2月8日(金) 必着 (メールもしくは FAX にてお申し込みください)

○申込先・お問い合わせ

ハイテクプラザ 技術開発部 工業材料科 (担当:高木、鈴木)

電話:024-959-1737

-----エックス線光電子分光装置活用セミナー参加申込書-----

FAX:024-959-1761

E-Mail: hightech-kougyou@pref.fukushima.lg.jp

工業材料科 高木宛

会社名	
所在地	
電話番号	
(ふりがな) 御氏名	見学 <input type="checkbox"/> 第1部を希望 <input type="checkbox"/> 第2部を希望 <input type="checkbox"/> 希望しない
(ふりがな) 御氏名	見学 <input type="checkbox"/> 第1部を希望 <input type="checkbox"/> 第2部を希望 <input type="checkbox"/> 希望しない

*見学のお時間につきましては、申し込み受付後こちらから確認のご連絡をさせていただきます。